

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
28. April 2005 (28.04.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/038077 A2

(51) Internationale Patentklassifikation: C23C 14/32
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/011669
(22) Internationales Anmeldedatum:
15. Oktober 2004 (15.10.2004)
(25) Einreichungssprache: Deutsch
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
(30) Angaben zur Priorität:
03405753.9 17. Oktober 2003 (17.10.2003) EP
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): PLATIT AG [CH/CH]; Moosstrasse 68-78, CH-2540

Grenchen (CH). PIVOT A.S. [CZ/CZ]; Průmyslova 3, 787
01 Sumperk (CZ).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): CSELLE, Tibor
[DE/CH]; Fichtenweg 1a, CH-2540 Grenchen (CH).
JILEK, Mojmir [CZ/CZ]; Janosikova 12, 787 01
Sumperk (CZ).

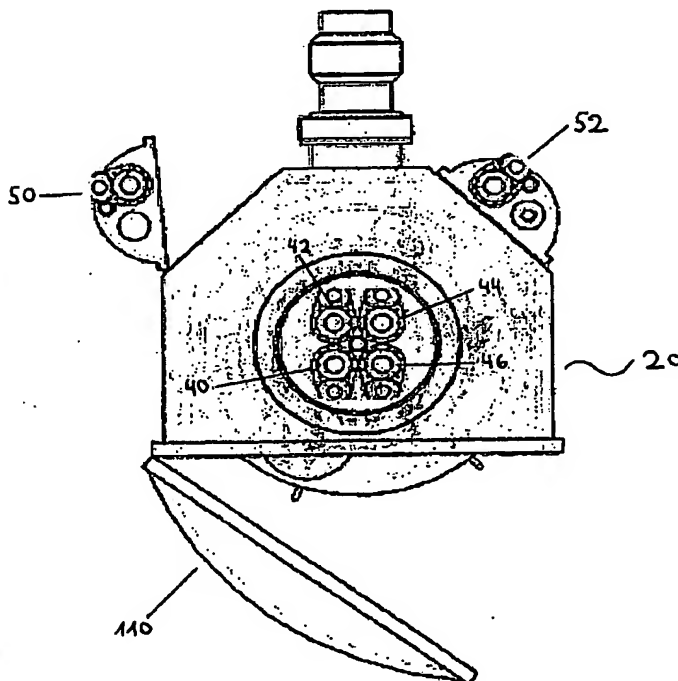
(74) Anwalt: R.A. Egli & Co.; Horneggstrasse 4, Postfach,
CH-8034 Zürich (CH).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: MODULAR DEVICE FOR COATING SURFACES, ESPECIALLY FOR THE MODULAR, DEDICATED COATING
OF SURFACES

(54) Bezeichnung: MODULARE VORRICHTUNG ZUR BESCHICHTUNG VON OBERFLÄCHEN, INSBESONDERE ZUR
MODULAREN, DEDIZIERTEN BESCHICHTUNG



(57) Abstract: The invention relates to a vacuum chamber for coating items (10) in which a physical vapor deposition method (PVD) is carried out. The aim of the invention is to create a vacuum chamber of the aforementioned kind which can be provided with modular cathodes. For this purpose, the vacuum chamber is provided with a plurality of receiving devices in which a plurality of cathodes each can be arranged. A first receiving device (30) for receiving one or more cathodes (40, 42, 44, 46) is provided substantially in the center of the vacuum chamber (20) and two additional receiving devices (32, 34) for receiving at least one cathode (48, 50, 52, 54) each are provided on the edges of the vacuum chamber (20) in a door-like manner.

(57) Zusammenfassung: Um eine Vakuumkammer zum Beschichten von Gegenständen (10), in der ein physikalisches Abscheidungsverfahren (PVD) durchgeführt werden kann, modular mit Kathoden bestücken zu können, wird vorgeschlagen, eine Vielzahl von Aufnahmeeinrichtungen vorzusehen, in die jeweils mehrere Kathoden angeordnet werden können. Eine erste Aufnahmeeinrichtung (30) zur Aufnahme von einer

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/038077 A2